第85類	電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

注

1及び2　［略］

3　第85.07項の「蓄電池」には、エネルギーを蓄積及び供給する蓄電池の機能に貢献し又は蓄電池を損傷から保護する補助部品（例えば、接続子、温度制御装置（サーミスター等）及び回路保護装置）とともに提示するものを含むものとし、また、蓄電池が使用される物品の保護ハウジングの一部を取り付けたものを含む。

4　［略］

5　［略］

6　［略］

7　［略］

8　［略］

9　第85.41項及び第85.42項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a)　［略］

(b)　「集積回路」とは、次の物品をいう。

(i)～(iii)　［略］

(iv)　マルチコンポーネント集積回路（ＭＣＯ）（一以上のモノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路又はマルチチップ集積回路と、少なくとも一のコンポーネント（シリコンベースセンサー、シリコンベースアクチュエーター、シリコンベースオシレーター、シリコンベースレゾネーター若しくはこれらを組み合わせたもの、第85.32項、第85.33項若しくは第85.41項に属する物品の機能を有するコンポーネント又は第85.04項に属するインダクター）とを結合した回路で、ピン、リード、ボール、ランド、バンプ又はパッドを通して、印刷回路基板（ＰＣＢ）その他のキャリア上への組立てに使用する種類の部品として、集積回路と同様に実用上不可分の状態に一体化されているもの）

この定義において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

1　「コンポーネント」は、個別部品であるか、独立して製造された後にＭＣＯの土台の上に組み立てられているか又は他のコンポーネントに組み込まれているかを問わない。

2　「シリコンベース」とは、シリコン基板上に形成され、シリコン材料で作られ又は集積回路ダイの上に製造されていることをいう。

3(a)　「シリコンベースセンサー」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位によつて生ずる物理量又は化学量を検出し、これらを電気信号に変換する機能を有するものである。

「物理量又は化学量」は、圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、歪（ひず）み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化学物質濃度等の実世界の現象に関連する。

(b)　「シリコンベースアクチュエーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変換する機能を有するものである。

(c)　「シリコンベースレゾネーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有するコンポーネントである。

(d)　「シリコンベースオシレーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する能動コンポーネントである。

第85類	電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

注

1及び2　［同左］

［新規］

3　［同左］

4　［同左］

5　［同左］

6　［同左］

7　［同左］

8　第85.41項及び第85.42項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(a)　［同左］

(b)　「集積回路」とは、次の物品をいう。

(i)～(iii)　［同左］

［新規］